ICTイノベーションフォーラム2011 2011.10.4, 於幕張メッセ国際会議場

## 数Tbit/inch<sup>2</sup>磁気記録密度実現のための オールホイスラー合金磁気抵抗素子の開発

### 東北大院工 大兼 幹彦

### Introduction ~ハードディスクの記録密度の推移~



記録密度の向上には、ヘッドの高性能化が不可欠

Introduction ~次世代磁気ヘッドのターゲット~



低抵抗かつ高磁気抵抗比の磁気抵抗素子が必要

## Introduction ~CPP-GMRの理論~

T. Valet & A. Fert model (Phys. Rev. B 48,10(1993))
CPP-GMRはbulkとinterfaceのスピンの非対称性に依存した現象



#### Introduction ~ハーフメタルホイスラー合金~



代表的なハーフメタルホイスラー合金

| 組成      | キュリー温<br>度 (℃) | バンドギャッ<br>プ (eV) | 磁気モーメ<br>ント (µ <sub>B</sub> /f.u.) |
|---------|----------------|------------------|------------------------------------|
| NiMnSb  | 730            | 1.55             | 4.0                                |
| Co₂MnSi | 985            | 0.7              | 5.0                                |
| Co₂MnGe | 905            | 1.04             | 5.0                                |



## Introduction ~Co<sub>2</sub>Fe<sub>x</sub>Mn<sub>1-x</sub>Si ホイスラー合金~



#### **Purpose**

# ハーフメタルホイスラー合金を用いた CPP-GMR素子において、室温で70%を 超える高磁気抵抗特性を得る

数Tbit/inch<sup>2</sup>磁気記録密度対応のハード ディスクヘッド応用に対する有用性を示す

## Experimental method (CMS vs CFMS vs CFS)

#### **Deposition :**

UHV magnetron sputtering (ULVAC Inc.) *P* base  $< 4 \times 10^{-8}$ **Micro-fabrication :** 

Photo litho., EB litho., Ar ion milling, RIE

#### **Characterization :**

DC 4 probe method



## **Structural properties**





## **Structural properties (STEM)**

#### **Bottom interface**

**Top interface** 



L2<sub>1</sub>-ordering (even at interface) was confirmed



CMS : MR ratio = 31.6%,  $RA = 40.3 \text{ m}\Omega \cdot \mu \text{m}^2$ ,  $\Delta RA = 12.7 \text{ m}\Omega \cdot \mu \text{m}^2$ CFMS : MR ratio = 37.1%,  $RA = 149.9 \text{ m}\Omega \cdot \mu \text{m}^2$ ,  $\Delta RA = 55.6 \text{ m}\Omega \cdot \mu \text{m}^2$ CFS : MR ratio = 36.2%,  $RA = 74.8 \text{ m}\Omega \cdot \mu \text{m}^2$ ,  $\Delta RA = 27.1 \text{ m}\Omega \cdot \mu \text{m}^2$ 

## **Experimental method (Thickness dep. of CFMS)**

**Deposition** :

UHV magnetron sputtering (ULVAC Inc.) *P* base  $< 4 \times 10^{-8}$ **Micro-fabrication :** 

Photo litho., EB litho., Ar ion milling, RIE

#### **Characterization :**

DC 4 probe method



Experimental result (Thickness dep. of CFMS)



 $\Delta RA = 55.8 \text{ m}\Omega \cdot \mu \text{m}^2$ 

 $\Delta RA = 128.1 \text{ m}\Omega \cdot \mu \text{m}^2$ 

上部のCFMSが3nmと10 nmの時、 最大で50%,74%と、非常に大きな磁気抵抗効果を観測した。 (3層構造のCPP-GMRでは現在、世界最大!!)





まとめ

 Co<sub>2</sub>Fe<sub>0.4</sub>Mn<sub>0.6</sub>Siホイスラー合金を電極に用いた CPP-GMR素子において、室温で74%の磁気抵抗比を 達成した。(現在の世界最高値)

 開発したCPP-GMR素子は、1平方インチ当たり、5テラビット容量のハードディスクヘッドの性能ターゲットに 到達している。



今後、ホイスラー合金電極CPP-GMR素子が次世代磁気 ヘッドの主流として研究開発が進んでいくと考えられる